

Спектральный рефлектометр

Ellipso-RR

Спектральная рефлектометрия (SR) является надежным, быстрым и точным методом для анализа толщины пленки и оценки ее отражательной способности. Ellipso-RR обладает уникальной передовой технологией анализа m -FFT для точного и быстрого измерения тонких пленок.



EIII-RP

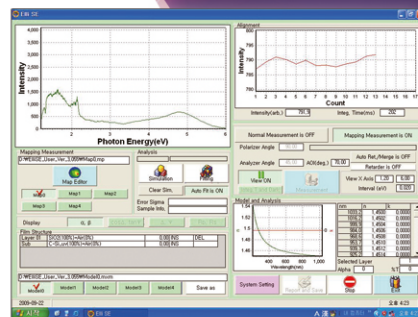
ОСОБЕННОСТИ

- Простота и высокая скорость измерений
- Высокая воспроизводимость анализа
- Бесконтактный неразрушающий метод анализа
- Возможность измерения многослойных материалов
- Измерение отражательной способности передней и задней поверхностей
- Опции 2D- и 3D-картирования поверхности



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Рабочий спектральный диапазон: 400 – 950 нм (УФ и ИК опции)
- Диаметр измерительного пятна: 1 мм
- Диапазон толщин: От 20 нм до 20 мкм (зависит от типа пленки)
- Количество анализируемых слоев: До 3 слоев (зависит от типа пленки)
- Скорость анализа: 1 сек/точка (зависит от типа пленки)
- Воспроизводимость (3σ): ± 0.1 нм на 10 измерений
- Рабочее расстояние: 120 мм (возможность кастомизации)



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Определение толщины тонких пленок диэлектриков, полупроводников, полимеров;
Измерение отражательной способности; Анализ сверхтонких и сверхтолстых пленок;
Оптические покрытия

ОПЦИИ

1. Система автоматического картирования ($\varnothing 150$ мм, $\varnothing 200$ мм, $\varnothing 300$ мм)
2. Опции расширения рабочего диапазона: UV1: 193 – 1050 нм; IR1: 900 – 1700 нм; IR2: 900 – 2200 нм
3. Измерение толстых пленок до 300 мкм